

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于公司牵头的国家重大科学仪器设备开发专项项目 通过综合验收的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）牵头的国家重大科学仪器设备开发专项“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”项目由公司联合上海理工大学、中国科学院上海光学精密机械研究所、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、南开大学等 6 家单位共同完成。该项目总体目标包括攻克纳米干涉细分、纳秒时序下空间调制同步与纳米精度控制、3D 导航 Z-校正和海量数据处理的关键技术，开发紫外空间光调制、共焦成像检测关键部件和大数据量图形软件，研制出具有自主知识产权的纳米图形化直写与成像检测仪器等。项目主要解决了微纳结构光场的可调控技术、图形的高速率写入机制、微纳结构与纳米精度多轴光机系统的设计与可靠性等难题；面向无掩模光刻，研制了紫外激光直写光刻的关键技术、软件和装备；实现了从纳米光子晶体结构到微米级任意结构的高效率光刻，与目前其他激光直写技术相比，速度更快、效率更高。

二、项目验收情况

公司于近日收到由国家科学技术部下发的验收文件【国科资函[2019]14 号】，公司牵头的国家重大科学仪器设备开发专项“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”项目进展顺利，进度和成果产出达到任务书要求的考核指标，顺利通过综合验收。

三、对公司的影响及风险提示

本次“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”项目的验收通过，在

研发创新与技术进步、推动国产科学仪器进口替代、支撑重大需求与重点工程等方面取得了较好的成就，对提高公司研发创新能力、提升产品的核心竞争力具有积极的推动作用，有利于促进公司产品升级，为公司健康、可持续发展奠定了坚实的基础。

此次项目通过验收的事项不会对公司近期财务状况、生产经营产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 23 日